

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 6 部門第 2 区分
【発行日】 令和 6 年 10 月 18 日 (2024.10.18)

【国際公開番号】 WO2023/153373
【出願番号】 特願 2023-580244 (P2023-580244)
【国際特許分類】
G 0 2 B 2 6 / 0 8 (2 0 0 6 . 0 1)
G 0 2 B 2 6 / 1 0 (2 0 0 6 . 0 1)
【 F I 】
G 0 2 B 2 6 / 0 8 E
G 0 2 B 2 6 / 1 0 1 0 4 Z

10

【手続補正書】
【提出日】 令和 6 年 8 月 2 日 (2024.8.2)
【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲
【補正対象項目名】 全文
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項 1】

20

電磁波を反射するミラーと、
前記ミラーを収容し、開口を有する筐体と、
前記開口に設けられる透過部材と
を備え、
前記透過部材は、電磁波の少なくとも一部を透過するように構成され、
前記筐体は、前記開口の反対側に位置する底面を有し、
前記ミラーは、前記底面に対して傾斜して前記筐体に収容されている、電磁波偏向装置
。

30

【請求項 2】

前記ミラーは、反射した電磁波で所定の範囲を走査するように姿勢を制御可能に構成され、入射した電磁波の前記透過部材の表面での反射波が前記所定の範囲の外に進行するように前記筐体に収容されている、請求項 1 に記載の電磁波偏向装置。

【請求項 3】

前記ミラーは、電磁波の反射面が前記透過部材と平行にならないように姿勢を制御可能に構成されている、請求項 1 に記載の電磁波偏向装置。

【請求項 4】

前記透過部材は、前記筐体の底面に対して略平行もしくは平行で前記筐体に接合されている、請求項 1 に記載の電磁波偏向装置。

40

【請求項 5】

前記ミラーを保持する基板と、前記基板を載置する載置部とを備え、
前記基板は、前記底面に対して傾斜して前記載置部に載置されている、請求項 1 に記載の電磁波偏向装置。

【請求項 6】

前記ミラーは、前記基板に沿って延びる第 1 軸の周りで傾斜可能に構成され、
前記基板は、前記ミラーが前記第 1 軸の周りで傾斜したときの前記透過部材の表面に対する傾斜角度の最大値である第 1 最大傾斜角度の 2 倍より大きい角度で前記底面に対して前記第 1 軸の周りに傾斜して前記載置部に載置されている、請求項 5 に記載の電磁波偏向装置。

50

【請求項 7】

前記ミラーは、さらに、前記第 1 軸に交差し、かつ、前記基板に沿って延びる第 2 軸の周りで傾斜可能に構成され、

前記ミラーが前記第 2 軸の周りで傾斜したときの前記透過部材の表面に対する傾斜角度の最大値である第 2 最大傾斜角度が前記第 1 最大傾斜角度よりも大きい場合、前記基板は、前記第 1 軸の周りで前記底面に対して前記第 1 最大傾斜角度の 2 倍より大きい角度で傾斜するように前記載置部に載置され、

前記第 2 最大傾斜角度が前記第 1 最大傾斜角度よりも小さい場合、前記基板は、前記第 2 軸の周りで前記底面に対して前記第 2 最大傾斜角度の 2 倍より大きい角度で傾斜するように前記載置部に載置され、

前記第 1 最大傾斜角度と前記第 2 最大傾斜角度とが等しい場合、前記基板は、前記第 1 軸及び第 2 軸の少なくとも一方の軸の周りで前記底面に対して前記第 1 最大傾斜角度の 2 倍より大きい角度で傾斜するように前記載置部に載置される、請求項 6 に記載の電磁波偏向装置。

10

【請求項 8】

前記ミラーは、前記基板に沿って延びる第 1 軸の周りで傾斜可能に構成され、

前記基板は、前記第 1 軸に交差する方向に沿った軸の周りに傾斜している、請求項 5 に記載の電磁波偏向装置。

【請求項 9】

請求項 1 から 8 までのいずれか一項に記載の電磁波偏向装置と、

前記透過部材に対して所定の角度で電磁波を入射させる照射部とを備える、電磁波走査装置。

20

【請求項 10】

前記ミラーで反射した電磁波で所定の範囲を走査するように前記ミラーの姿勢を制御する制御部を更に備え、

前記ミラーは、入射した電磁波の前記透過部材の表面での反射波が前記所定の範囲の外に進行するように前記筐体に收容されている、請求項 9 に記載の電磁波走査装置。

【請求項 11】

前記制御部は、前記ミラーの電磁波の反射面が、前記透過部材と平行にならない範囲で、前記ミラーの姿勢を制御する、請求項 10 に記載の電磁波走査装置。

30

40

50